⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 177446

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)9月11日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 G 11 C 13/04 A-8421-5D 7447-2H 7341-5B

審査請求 有 発明の数 2 (全6頁)

光ディスク記録媒体

②特 顧 昭59-31458

②出 願 昭59(1984)2月23日

⑫発 明 者 舩 越

宜博

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話公社茨城電気通信研究所内

①出・願 人

日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

⑩代 理 人 弁理士 光石 士郎 外1名

明 細 割

1. 発明の名称

光ディスク記録媒体

2. 特許請求の範囲

(1) 一般式

(In_{1-X}Sb_X)_{1-Y}M_Y

で表わされる組成の合金膜を記録層に有する ことを特徴とする光ティスク記数媒体。ただ し一般式における X 、 Y はそれぞれ

5 5 重量 % ≤ X ≤ 8 0 重量 %、

· 0 重量 # ≤ Y ≤ 2 0 重量 #

であり、MはAu、Ag、Cu、Pd、Pt、AL、Si、Ge、Ga、Sn、Te、Se および Biのうちから選んだ少くとも一種を表わす。

(2) 一般式

 $(In_{1-X}Sb_X)_{1-Y}M_Y$

で表わされる組成の合金膜を記録層に有し、 さらに記録層上面に TeO2、 V2O3、 V3O5、 TiO2、 SiO2 などの酸化物又は Mg F2、Ce F3、 A&F3 などの弗化物のうちから選んだ少くと も一種を保護膜として釉質したことを特徴と する光デイスク記録媒体。ただし、一般式に おけるX、Yはそれぞれ

5 5 重量 8 ≤ X ≤ 8 0 重量 %、

0 重量 % ≤ Y ≤ 2 0 重量 %

であり、MはAu、Ag、Cu、Pd、Pt、AL、Si、Ge、Ga、Sn、Te、Se およびBi の うちから選んだ少くとも一種を扱わす。

3. 発明の詳細な説明

く技術分野>

本発明は書き換え可能な、新規な書き込み・再生用光ディスク記録媒体に関する。

く 従 来 技 術 >

光テイスクは、当初情報に応じて基板上に形成した凹凸状ピット列を記録層とし、ピット列を光学的にピックアップして情報を再生するものであつた。しかし、固体の相転移を利用した記録方式が開発されるに至り、単に再生するだけでなく、情報の書き込みおよびその再生の両者をレーザ光で行い、1 ピットを約2 4 角に書

き込むととができ、現在の高密度磁気デイスクと比較しても1桁以上高い記録密度を実現できるようになつた。また、磁気デイスクと異なり、情報を非接触で書き込み、再生および高速録声を ダムアクセスできるため、デイスクの記録録面を 劣化させるおそれがない。また、容易に配録面を を密封して保護する構造にすることができ、ホ コリ、傷などの影響を受けないようにすること ができるなどの利点をもつている。

審き換え可能で、書き込み・再生用光デイスクの記録媒体として従来からTe あるいは Te Ox (ただし、0 くx く2)が知られている。これらの記録媒体は、レーザ光照射された部分かととの記録は上になるように短時間限射すると、とのを開射部分を結晶化温度をやや上まわる温度とり記録を消去することとができ、書き替えてしまっても。しかし、Te はその結晶化温度が10℃~

ると擬安定相(以下、「π相」という。)になるが、徐冷するときは、InSbとSbの混相(平衡相)に転移し、しかもπ相にあるときなるとなるだけでなく、π相自体の安定性が高いことを知つた。しかも、π相にある(In_{1-x}Sb_x)_{1-y}M_y 系合金は相転移温度(百数十度C。)に加熱すると混相に転移させることができ、雑き込みに対きながにあるにあるにできることができ、なるのできたがあることを発見し、本発明を完成することができた。

く発明の目的>

すなわち、本発明は情報の智き込み、その再生、消去が容易であると共に、記録状態の相発 性が高く、しかも繰り返し書き込み、再生および消去が可能な光ディスク記録媒体を提供する ことを目的とする。

く発明の構成>

上記目的を達成するための本発明の光ティスク記録媒体は、一般式

記録情報の保存性の点で離があつた。他方、
TeOx (ただし、0くxく2。)は、非晶質相
の安定化のために、Sn、Ge 等の不純物を加え、
結晶化温度をコントロールすると共に、流性化
エネルギの増大により安定化させていた。しか
し、TeOx は酸素 なからない、これがあった。さらに、これがあった。なりに、これがあった。ない、これがあった。ない、これが表別にない、たいで、これがあった。とい次点があった。とい次点があった。とい次点があった。とい次点があった。とい次点があった。とい次点があった。とい次にが表別にない、一般り返し使用上欠点があった。

本発明者は、従来の光テイスク記録媒体における上述の事情に鑑み、光デイスク記録媒体について研究を重ねた結果、 $(In_{1-x}Sb_x)_{1-y}M_y$ 系合金(ただし、 M_Y は Au、 Ag、 Cu、 Pd、 Pt、 AL、 Si、 Ge、 Ga、 Sn、 Te、 Se およひ Bi の うちから邀んだ少くとも一種。)は、 溶融状態 に 酸点 5-0-0 で 6-7-0 で配度。)から 室温まで 10⁶ で/sec以上の 冷却速度で急冷す

 $(In_{1-X}Sb_X)_{1-Y}M_Y$ で表わされる組成の合金膜を記録層に有することを特徴とするものである。ただし、上記一般 式における X、 Y はそれぞれ

5 5 重量 % ≤ X < 8 0 重量 %

0 重量 男 ≤ Y ≤ 2 0 重量 男 であり、M は Au 、 Ag 、 Cu 、 Pd 、 Pt 、 Al 、 Si 、 Ge 、 Ga 、 Sn 、 Te 、 Se および Bi の う ちから選んだ少くとも 1 種を装わす。

また、一般式

 $(In_{1-X}Sb_X)_{1-Y}M_Y$ で表わされる組成の合金膜を記録層に有し、さらに記録層上面に TeO_2 、 V_2O_3 、 V_3O_5 、 TiO_2 、 SiO_2 などの酸化物又は MgF_2 、 CeF_3 、 $A4F_8$ などの弗化物のうちから選んだ少くとも一種を保護 腱として積層したことをも特徴とするものである。ただし、一般式におけるX、Y はそれぞれ

5 5 重量 % ≤ X ≤ 8 0 重量 %、
0 重量 % ≤ Y ≤ 2 0 重量 %

であり、Mは Au、 Ag、 Cu、 Pd、 Pt、 Al、 Si、 Ge、 Ga、 Sn、 Te、 Se およひ Bi のう ちから選んだ少くとも一種を扱わす。

上記一般式(In1-xSbx)1-yMy系合金は、Sb の添加量が55重量のより少なくなると第1 図に示す範囲Bのごとく混相を形成し、π相(第1 図に示すA の範囲の組成のもの。)を形成しなくなり、80重量のを越えるとSb の単一相ことなり混相を形成しなくなるため、π相および混相間の相転移を利用した情報の書き込み、再生および書き替えができなくなる。

(In_{1-X}Sb_X)_{1-Y}M_Y系合金において、M_Yの 添加量 Y が 2 0 重量 8 を越えたときも合金は π 相を形成しなくなり、上述の場合と同じように 相転移による情報の書き込み、再生および香き潜えができなくなる。さらに、 添加金属 M 組成 対相転移温度との関係では第2 図に示すごとく、 Te、 Se および Bi の 場合は曲級 a、 b 間に挟まれる範囲 I 内で、これら金属の 種類、組合せにより 種々に変えることができ、 Au、 Ag、

実施例1

(a) 光ティスク記録媒体の作製

In および Sb をそれぞれ 3 0 重量がおよび70 重量の創合で混合した素材を、石英るつぼ中 に入れ、高周放加熱炉中で 6 4 5 ℃に加熱溶融 した後、炉内自然放冷して In_{0.3}Sb_{0.7}材料を得 ることができた。

次いて、第3図に示すように、ベルジャ1内 上部に径20mのポリメチルアクリレート(以 下、「PMMA」という。)製円板2を支持器3 で保持すると共に、ベルジャ1内に、上配工 程で得られたIn_{0.3}Sb_{0.7} 材料4を入れたジルコニア製るつぼ5、電子ビーム発生源6を配置し、排気装置7によりベルジャ1内を1×10⁻⁴~1×10⁻⁵ Torrに排気し、電子ビーム発生源6からるつぼ5内のIn_{0.3}Sb_{0.7} 材料4に電子ビームを照射し、In_{0.3}Sb_{0.7} を蒸発させた。ついて、ベルジャ1内を常圧にもどし、円板2を自然放冷した。 Cu、Pd およびPt の場合は曲線 e、f に挟まれる範囲 II 内で変えることができ、AL、Si、Ge、Ga およびSn の場合は曲線 c およびd で挟まれる範囲 II 内で変えることができる。さらに、範囲 1、 II および II の相転移温度を示す各クループの金属のうち、異種範囲に 属する金属の組合せを変えることによつて、120~160℃の範囲内において適当な範囲に転移温度をもつ合金を得ることができる。

上述の光デイスク記録媒体は、情報を書き込む場合は、記録階にパワーの高いレーザ光を照射して溶融させてから室温に自然放冷させると、10⁶℃/sec以上の冷却速度で急冷されてπ相に転移し、情報の書き込みができると共に、π相の媒体にパワーの小さいレーザ光を照射すると混相へ相転移し情報は消去できるので、記録媒体に再沓き込みが可能になる。

〈 実 施 例 〉

以下、本発明の代表的な実施例について説明する。

得られた PMMA円板 2 (以下、「試料 No 1 」という。)上の In_{0.3} Sb_{0.7} 合金膜の膜厚を測定したところ 2 5 0 Å であつた。

⑥光ディスク記録媒体の性能

上述の工程によつて得られた試料NO.1の In_{0.8}Sb_{0.7} 合金膜面を上に向け、第4図に示す 群き込み・再生装置によつて性能を測定した。

第4図に示す書き込み・再生装置において、 書き込み側は、情報入力源10、書き込み制御 装飾11、GaAs 半導体レーザ12、集光レン ズ13、ミラー14からなつており、試料への 書き込み時のGaAs 半導体レーザの光出力は8 mW で行つた。

再生側は、GaAs 半導体レーザ15、集光レンズ16、ピームスプリッタ17、トラッキングミラー18、光検出器19、再生出力制御装置20、テレビモニタ21とからなつており、上述のGaAs 半導体レーザ12の光出力で替き込まれた記録を、GaAs 半導体レーザからの光出力を0.8 mW にして、光検出器19 に得られる

再生信号を再生装置20を介して搬送波対雑音 比(以下、「C/N 比」という。)を調べたと ころ55%であつた。

さらに、上記C/N 比測定終了後、試料Nalの情報報き込み面を、出力4mWのGaAs半導体レーザ光で走査したところ、響き込み情報を消去することができた。

実施例2

蒸発源として In_{0.45} Sh_{0.55} 材料を用いた他は 実施例1と同様の方法で PMMA円板上に、250 A 厚の In_{0.45} Sh_{0.55} 合金膜を形成した試料を得 た。 この試料Na 2 について、実施例1と同じ方 法にしたがつて、C/N 比を測定したところそ の値は55 多であつた。また、この試料Na 2 に 書き込まれた情報は、5 mW の GaAs 半導体レ ー ザだび試料面を走査することによつて消去する ことができた。

実施例3

奥 旅 例 4

蒸発源として、それぞれ(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}Au_{0.1}、(In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.9}Au_{0.1}、(In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.8}Au_{0.2}、

を、蒸溜額の材料 4 として Mg F2 を用いた以外は第 3 図と同じ装置 かよび方法によつて、各試料の合金膜上に保護膜として Mg F2 の蒸滑膜を1,000 Å~2,000 Å 厚に被滑させ、第 4 図の装置によつて C/N 比を測定したところ、書

実施例1、2、3によつて作製された各試料

き込みレーザ出力を 1 0 ~ 1 3 mW にし、消去 時には 5 ~ 8 mW であり、記録再生には 1~1.5

mW を必要とすることが判つた。

また、C/N 比は55%で、保護膜を被滑しないものと同じことが判つた。

また、本実施例の保護膜は Mg F2 を使用した ものについて説明したが、他の弗化物 Ce F3、 A L F3 又は Te O2、 V2 O3、 V3 O5、 Ti O2、 Si O2 などの酸化物膜を保護膜として形成させた場合 にも、同様の結果を得た。

上記実施例において、PMMA 製円板上への (In_{1-X}Sb_X)_{1-Y}M_Y 合金の蒸**滞膜は真**瓷蒸着法に よつて被滑させる方法について説明したが、真

(Ino.45Sbo.55)0.9Auo.1 (Ino.3Sbo.7)0.8Ago.2 $(In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.8}Ag_{0.2}$, $(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.8}Cu_{0.2}$, (Ino.3 Sbo.7)0.8 Ago.2 . (Ino.2 Sbo.8)0.8 Ago.2 . (Ino.45Sbo.55)0.8Pdo.2 (Ino.3Sbo.7)0.8Pdo.2 . (In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.8}Pd_{0.2} . (In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}Pt_{0.1} . (Ino.3Sbo.7)0.9Pto.1 (Ino.2Sbo.8)0.9Pto.1 . (Ino.45 Sbo.55)0.9 ALO.1. (Ino.3 Sbo.7)0.9 ALO.1. (Ino.2Sbo.8)0.9AL0.1, (Ino.45Sbo.55)0.9Sio.1. $(In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.9}Si_{0.1}, (In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.9}Si_{0.1},$ (Ino.45 Sbo.55)0.9 Geo.1. (Ino.3 Sbo.7)0.9 Geo.1. (Ino.2Sbo.8)0.9Geo.1. (Ino.45Sbo.55)0.9Gao.1. (Ino.3 Sbo.7)0.9 Gao.1. (Ino.2 Sbo.8)0.9 Gao.1. $(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}Sn_{0.1}$, $(In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.9}Sn_{0.1}$, (Ino.2Sbo.8)0.9Sno.1. (Ino.45Sbo.55)0.9Teo.1. (In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.9}Te_{0.1}, (In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.9}Te_{0.1}, (Ino.45 Sbo.55)0.9 Bio.1 . (Ino.3 Sbo.7)0.9 Bio.1 . (Ino.2Sbo.8)0.9Bio.1を用いた以外は、実施例1 と同様の合金膜蒸磨方法および C/N 比測定方 法によりC/N 比を測定したところ、いずれも その値は55%であつた。

く発明の効果>

以上の説明から明らかなように、本発明による光ディスク配録媒体は、

① <u>さらに</u> Te、TeOxなど従来の光デイスク
記録媒体の相転移温度が10℃~60℃と低
いため、光デイスクの使用時中の温度上昇があっても書き込
み情報が消去されてしまうが、本発明の光デ
イスク記録媒体においては120℃~160 でになつてはじめてπ相、混相間の相転移が
おこるにすぎない。したがつて、智き込み情
報の安定性が高い。しかも、光デイスク記録
媒体の便用状況に合わせて、用いる記録媒体 の素材の 髄類、組み合せ割合を適当に選ぶことによつて 相転移温度を 1 2 0 ℃~ 1 6 0 ℃ の間で自由に選択できる。

② GaAs 半海体レーザ(他のレーザであつてもよい)の8~13mWの光出力で情報の警告込みが可能であり、得られる再生信号のC/N 比は55%程度であり、従来のTe、TeOx を使用した光テイスク記録媒体のC/N 比が60%程度であるのに比べて必ずしも高いとは云い待ないが、書き込んだ情報の安定性が高く、繰り返し再生できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の光デイスク記録媒体の
In1-xSbx 合金のπ相形成時の組成依存性とπ相から混相への相転移温度との関係を示す特性図、第2図は(In1-xSbx)1-yMy 合金におけるπ相形成の組成依存性とπ相から混相への相転移温度との関係を示す特性図、第3図は実施例の光ディスク記録

媒体の性能測定に利用した書き込み・再生装置 の概略構成図である。

(中面)

- 1 …ベルジヤ、
- 2 ··· PMMA基板、
- 4 …蒸着材料、
- 10…情報入力源、
- 12,15…GaAs 半導体レーザ、
- 17…ビームスプリッタ、
- 19 … 光検出器、
- 20…再生出力制御装置、
- 2 1 … テレビモニタ。

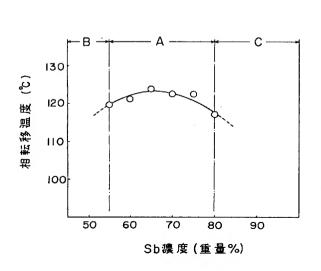
特許出願人

日本電信電話公社

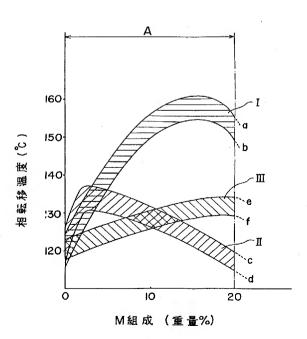
代理人

弁理士 光 石 士 郎 他1名

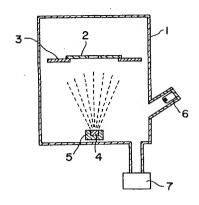
第 1 図



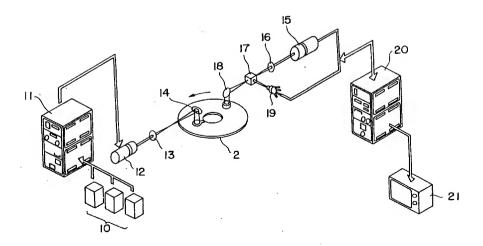
第 2 図



第 3 図



第 4 図



PAT-NO: JP360177446A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60177446 A

TITLE: OPTICAL DISK RECORDING

MEDIUM

PUBN-DATE: September 11, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

FUNAKOSHI, NORIHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP N/A

APPL-NO: JP59031458

APPL-DATE: February 23, 1984

INT-CL (IPC): G11B007/24, B41M005/26,

G11C013/04

US-CL-CURRENT: 347/264 , 428/457

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an optical disk recording medium which permits easy recording, reproducing, erasing and rerecording of information and has high phase stability of a recording state by forming an alloy layer consisting of In and Sb or In and Sb and a specific metal within a specific compsn. range.

CONSTITUTION: The alloy film expressed by the formula (X is $55wt\% \le X \le 80 \text{ wt}\%$, Y is $0wt\% \le Y \le 20wt\%$, M is ≥1 kinds selected from Au, Aq, Cu, Pd, Pt, Al, Si, Ge, Ga, Sn, Te, Se and Bi) is deposited by evaporation on a substrate 2 consisting of polymethyl methacrylate, etc. by irradiating an electron beam from, for example, an electron beam generating source 6 on an alloy material 4 contained in a crucible 5. A protecting film consisting of fluoride such as MgF2, AlF3 or the like or oxide such as TeO3, TiO2 or the like is then provided on an alloy layer. The suitable selection of the compsn. between 120~160°C phase transition temp. of the alloy layer is thus made possible. The recording medium which requires less writing energy and permits stable repeated erasing and writing in the recording phase is obtd.

COPYRIGHT: (C)1985, JPO&Japio